

АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ЛАЗЕРНОЙ ДЕСОРБЦИИ С *GaAs*
МЕТОДОМ ВРЕМЯПРОЛЕТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

А.А. Г л е б о в с к и й, А.А. Л и с а ч е н к о

Времяпролетная спектроскопия (ВПС) первичных продуктов десорбции все шире используется для анализа динамики физико-химических поверхностных процессов, индуцируемых лазерным облучением [1, 2].

Анализ спектральных зависимостей формы ВП-спектров для ряда объектов показал [3], что кинетическая энергия десорбционных поверхностных атомов скачкообразно возрастает при переходе от области несобственного в область собственного поглощения. Такой скачок объясним включением механизма передачи энергии рекомбинации электронно-дырочных пар. Однако эффект можно объяснить также резким возрастанием поглощаемой объемной мощности излучения, либо особенностями потенциала отталкивательного терма конечного состояния [4]. В связи с этим представляет интерес расширение класса исследуемых объектов, различающихся структурой зон, степенью ионности кристалла, характером адсорбционного потенциала поверхности.

В настоящей работе исследованы продукты лазерной десорбции с *GaAs*, который с одной стороны расширяет класс исследованных объектов и, кроме того, является важным технологическим материалом. Проведен масс-спектрометрический анализ состава продуктов десорбции и их распределений по кинетическим энергиям.

Опыты проводили на исследовательском комплексе [1], включающем: а) времяпролетный масс-спектрометр с автоматизированной системой регистрации быстропротекающих процессов на базе ЭВМ ДВК-3 и информационно-измерительной системы КАМАК; б) систему облучения образца импульсами излучения гармоник неодимового лазера ЛТИПЧ-5 (1064, 532, 354, 266 нм), длительностью 15 нс. Максимальная энергия импульса первой гармоники 30 МДж, плотности мощности излучения $P/S < 80 \text{ МВт/см}^2$.

Особенностью установки является наличие охлаждаемого жидким азотом экрана, что позволяет регистрировать состав и распределения по кинетическим энергиям только первичных (т. е. попадающих в ионный источник без соударений со стенками) продуктов десорбции. Одновременно регистрируется кинетика четырех компонентов масс-спектра.

Рабочий вакуум составлял $(2-3) \cdot 10^{-10} \text{ Тор}$, чувствительность по потоку молекулярного кислорода 10^8 мол/с (или 10^{-7} моно-слоя за вспышку), быстроедействие 10^{-5} с .

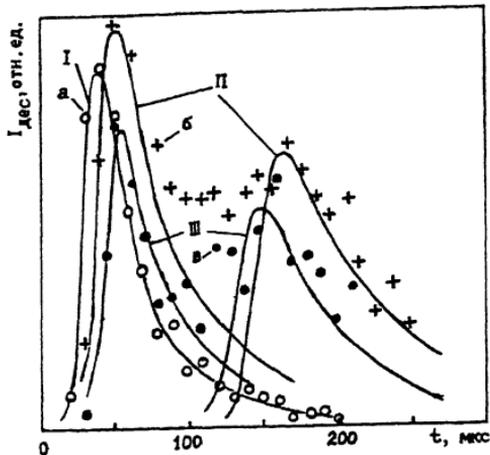


Рис. 1. ВПС H_2O , CO , CO_2 с поверхности GaAs . $\lambda=532$ нм, $P/S \sim 7$ МВт/см². а(о) - H_2O , б (+) - CO , в (●) - CO_2 ; сплошными линиями даны максвелловские распределения: I - для H_2O ($T_K=2800$ К), II - для CO ($T_K=2800$ К и 250 К), III - для CO_2 ($T_K=3500$ К и 320 К).

Исследовали два образца полуизолирующего GaAs : АГЧП-6 ($\rho > 10^7$ Ом/см) и АГП-1 ($\rho \sim 10^6$ Ом/см). Поверхность (100) до экспериментов была подвергнута полировке и химическому травлению, дополнительной обработки образцов перед опытом не проводили. Исследования проводили на длинах волн - 1064 и 532 нм. Засвечиваемые площади составляли 2.2 мм² на 1064 и 0.4 мм² на 532 нм, максимальные плотности падающей мощности соответственно 60 МВт/см² и 50 МВт/см².

При облучении образцов, откачанных при 10^{-10} Тор и $T=290$ К в течение 4-х часов на $\lambda=532$ нм обнаружена десорбция H_2O ($m/e=18$), CO (28), CO_2 (44), а также Ga (69, 71) и As (75).

Десорбция молекулярного кислорода ($m/e=32$) не обнаружено. Компоненты с $m/e > 80$ (GaO , GaOH и др.) не контролировали.

Компоненты кристалла Ga и As появляются при $P/S > 10$ МВт/см² для АГЧП-6 и $P/S > 20$ МВт/см² для АГП-1, при этом количество десорбируемых компонент $m/e=18-44$ с АГЧП-6 в ~ 2 раза выше, чем с АГП-1. Количественные соотношения между тяжелыми компонентами для обоих образцов в пределах погрешности одинаковы.

Анализ распределений десорбируемых продуктов по скоростям показал, что молекулы H_2O имеют максвелловское распределение с наиболее вероятной кинетической энергией $E_B=0.24$ эВ ($T_K=2800$ К) независимо от образца (рис. 1, кривая а).

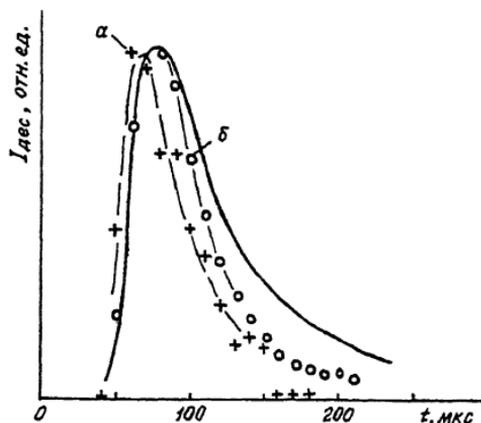


Рис. 2. ВП-спектры Ga и As с образца АГЧП-6; $\lambda = 532$ нм, $P/S \sim 15$ МВт/см². а (+) - Ga , б (o) - As , сплошная линия - максвелловское распределение для As ($T_k = 4400$ К).

В распределении молекул CO при десорбции с образца АГЧП-6 наблюдаются две формы с $E_B = 0.24$ эВ и 0.021 эВ (рис. 1, кривая б). С образца АГП-1 десорбция „медленной“ формы заметна только при малых интенсивностях P/S . При больших интенсивностях вклад „медленной“ формы практически не наблюдаем, а наиболее вероятная кинетическая энергия „быстрой“ формы увеличивается до 0.3 эВ ($T = 3500$ К).

В распределениях ^к молекул CO_2 для обоих образцов имеются две формы с $E_B = 0.31$ эВ и 0.03 эВ (рис. 1, кривая в). „Медленная“ проявляется только при малых амплитудах „быстрой“ формы. При большой интенсивности „быстрой“ формы (в частности, в первых вспышках) „медленной“ практически не заметно.

Распределения компонент кристалла по кинетическим энергиям немасвелловские (рис. 2, кривые а и б). Кинетические энергии соответствующие максимумам распределений:

	АГЧП-6	АГП-1
Ga	0.5 ± 0.1 эВ	0.6 ± 0.1 эВ
As	0.4 ± 0.1 эВ	0.4 ± 0.1 эВ,

На обоих образцах при больших интенсивностях десорбции ВП-спектры уширяются, но их форма не достигает максвелловской.

При воздействии излучения с $\lambda = 1064$ нм десорбции легких молекул ($m/e = 18, 28, 32$) не обнаружено. Десорбция компонент кристалла зарегистрирована с образца АГЧП-6 после 10-го импульса, а с АГП-1 после 30-го импульса с $P/S \sim 45-50$ МВт/см². С увеличением номера вспышки интенсивность десорбции медленно увеличивается, но соотношение между интенсивностями десорбции компонент сохраняется. Форма ВП-спектров обоих компонент немас-

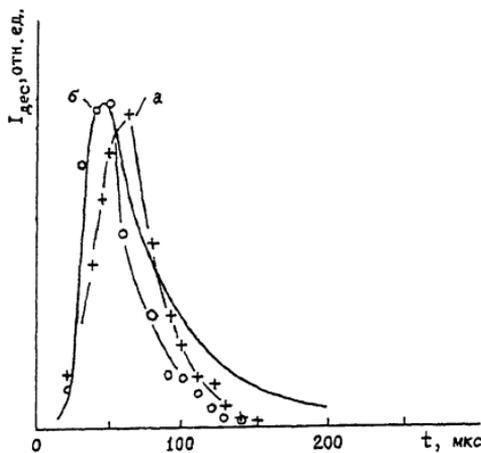


Рис. 3. ВП-спектры *Ga* и *As* с образца АГЧП-6; $\lambda = 1024$ нм, $P/S \sim 50$ МВт/см², $N > 10$. а (+) - *Ga*, б (o) - *As*, сплошная линия - максвелловское распределение для *As* ($T_K = 11000$ К).

велловская, а положения максимумов не зависят от образца и соответствуют кинетическим энергиям для *Ga* - 0.7 ± 0.2 эВ, для *As* - 0.9 ± 0.2 эВ (рис. 3).

Как и на $\lambda = 532$ нм кинетические энергии компонент кристаллов значительно превосходят энергии, соответствующие температуре плавления.

Оценки температуры поверхности поверхности при лазерном воздействии в области собственного поглощения, выполненные с помощью оптического зондирования [5, 6] дают величину не выше температуры плавления ($T = 1510$ К). В то же время по результатам пирометрических [7] и времяпролетных [8] измерений температура атомов, испаряемых с поверхности *GaAs* $T_K > 3000$ К, что согласуется и с результатами данной работы.

Полученные результаты можно резюмировать следующим образом. Лазерное облучение в областях как собственного, так и несобственного поглощения приводит к десорбции адсорбированных молекул и атомов вещества. Процессы протекают более эффективно (т. е. при меньших P/S) в области собственного поглощения. Облучение при $P/S < (1-2) \cdot 10^7$ Вт/см² на $\lambda = 532$ нм эффективно для „мягкой“ (без нарушения исходного кристалла) очистки поверхности.

При $P/S > (1-2) \cdot 10^7$ Вт/см² на $\lambda = 532$ нм и $P/S > 4.5 \times 10^7$ Вт/см² на $\lambda = 1064$ нм начинается разрушение поверхности. По-видимому, начальной стадией является разрушение слоя поверхностного оксида.

Новым и неожиданным является тот факт, что энергия „горячих“ атомов при облучении поверхности в области несобственного поглощения превышает энергию атомов, вылетающих при возбуждении в области собственного поглощения. Отсутствие обнаружимой десорбции адсорбированных молекул в области несобственного поглощения

указывает, что нагрев поверхности в этой области ниже, чем в области собственного поглощения и свидетельствует о нетермической природе эффекта. С другой стороны, полученный результат означает, что энергия рекомбинации электронно-дырочной пары не передается непосредственно продуктам десорбции. Таким образом, объяснение структуры ВП-спектра следует искать в энергетических особенностях оттапливательного термина десорбируемой частицы.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] М о и с е е н к о И.Ф., Г л е б о в с к и й А.А., Л и с а ч е н к о А.А. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1987. В. 7. С. 116.
- [2] Б ы к о в с к и й Ю.А., П о т а п о в М.М., У к р а и н ц е в В.А., Ч и с т я к о в А.А. // Химия выс. энергий. 1987. Т. 21. С. 361.
- [3] М о и с е е н к о И.Ф., Л и с а ч е н к о А.А. // Поверхность. 1989. В. 7. С. 150.
- [4] Г л е б о в и ц к и й А.А., М о и с е е н к о И.Ф., Л и с а ч е н к о А.А. // Изв. АН СССР. Сер. физическая. Т. 53. В. 3. С. 568.
- [5] L o w n d e s D.N., W o o d R.F., W e s t - b r o o k R.D. // Appl. Phys. Lett. 1983. V. 43. N 3. P. 258.
- [6] A u s t o n D.N., S u r k o S.M., V e n k a t e s a n T.H.S., B l u s h e r R.E., G o l o v c h e n k o J.F. // Appl. Phys. Lett. 1978. V.33. N5. P.437
- [7] П и л и п о в и ч В.А., И в л е в Г.Д., Ж и д к о в В.В., М а л е в и ч В.Л. // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9. В. 7. С. 594.
- [8] S t r i t z k e r B., P o s p i e s z c z u k A., T a g l e J.A. // Appl. Rev. Lett. 1981. V. 47. N 5. P. 356.

С.-Петербургский государственный университет

Поступило в Редакцию
28 мая 1992 г.